

MPI TS300-SE | ShieldEnvironment™付300 mmマニュアル・プローバー

広温度範囲 DC/CV、RF測定用マニュアル・プローバー

顕微鏡マウントおよび移動機構

- 剛性の高い顕微鏡ブリッジ(保持機構)
- リニアリフト(構成変更が容易に)
- 50×50 mm XYリニア機構

DCおよびRFポジショナ

- 最大RF 4台またはDC 8台まで搭載可能
- さまざまなポジショナより選定可能
- 測定用途に合わせて、同軸、トライアキシャル、ケルビン、RFアームのラインアップ

RFキャリブレーション

- 校正基板用2つの補助チャック
- 高精度な校正のためのセラミック材質
- 平坦度1 μm (高コンタクト精度)

プローブ・プラテン

- 高剛性、安定設計
- RFポジショナ用角型調整器
- エアークーリング内蔵プラテンで熱安定設計

独自のプラテンリフト

- コンタクト、コンタクト・セパレーション(300 μm)、ロード(3 mm)の3つの独立したポジショニング
- セーフティ・ロック機能
- Probe Hover Control (PHC™) - ホーバ高さ調整機能(50,100または150 μm)がついており、パッドにプローブを簡単に便利に当てる事が可能
- ±1 μmの再現性をもつ高コンタクト精度「オート・コンタクト」

ShieldEnvironment™

- EMIシールド、遮光環境により、超低ノイズ・低キャパシタンス測定を実現
- 広い前面ドアよりIC/ウェハ-の出し入れ、ShieldCap™
- 常時シールドされた状態で、構成変更が簡単
- RF4ポートおよびDC/ケルビン 8ポート
- 4.5インチ プローブ・カード・アダプタ (オプション)
- 結露防止対策用 前面ドア自動ロック機能

顕微鏡および顕微鏡オプション

- さまざまな顕微鏡より選定可能
- iMAG®デジタル顕微鏡/MPI単眼鏡筒SZ10/MZ12(12倍ズーム、作動距離95 mm)
- パソコンいらずのHDMI接続差端子付きCCDカメラ

温度チャックインテグレーション

- タッチスクリーンによる完全制御
- 温度制御、操作が簡単

モジュール式チャック

- さまざまな常温、温度チャック(MPI/ERS社製)
- トライアキシャル/同軸チャックより選定
- 広温度範囲に対応可能(下限温度-60°Cから上限温度300°Cまで)
- フィールドにてアップグレード可能
- センター(小さな被測定物)、小ウェハ-との切替が簡単

ケルビン・インタフェース

- ケルビン・インタフェース(オプション)をご用意(ケーブルまわしが容易に)

チャック XY/θステージ機構

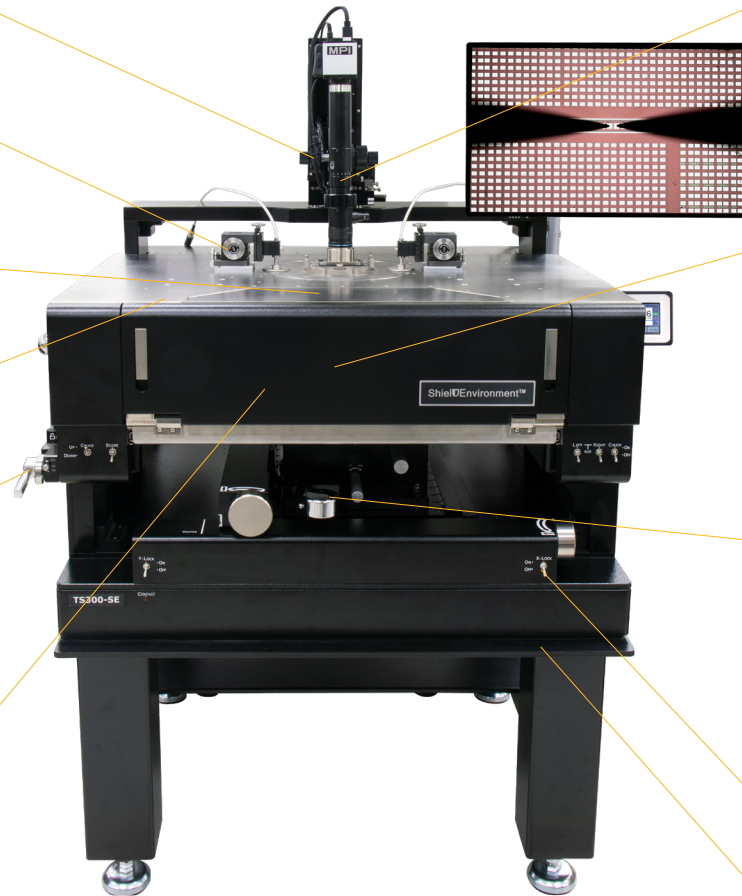
- エア・ベアリング・ステージにより片手で簡単にXYポジショニング
- 225 x 260 mm XYステージ移動範囲
- < 1.0 μm 精度 @ 500 μm/解像度
- 20 mm空気圧リフトによるウェハ-のロード/アンロード
- 5 mm高精細Z軸精度 (< 1.0 μm @ 500 μm/解像度)
- ±5°θ微調整機構
- ロードが簡単な広いY軸設計

真空制御を前面に設置

- 操作が容易に
- チャック用、補助チャック用を明記

一体型防振テーブル

- 省スペース設計
- 高さを抑え操作性を最大限に引き出す設計に



オプション

- 真空ポンプ/エア・コンプレッサ
- デュアル・モニタ・スタンド
- 測定器トレイ